

東北大学材料科学高等研究所共通利用機器等及び使用料に関する内規

平成27年9月11日

機構長裁定

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学材料科学高等研究所共通利用機器等使用内規第2条及び第9条第2項の規定に基づき、東北大学材料科学高等研究所が利用に供する研究設備及び機器（以下「設備等」という。）の使用に関し、対象となる設備等及び使用料について定めるものとする。

(設備等)

第2条 使用の対象となる設備等及び使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

附 則

この内規は、平成27年10月1日から施行する。

附 則（平成27年10月30日改正）

この内規は、平成27年10月30日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年11月1日から適用する。

附 則（平成28年5月17日改正）

この内規は、平成28年5月17日から施行し、改正後の別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附 則（平成29年1月31日改正）

この内規は、平成29年1月31日から施行し、改正後の別表の規定は、平成29年1月1日から適用する。

附 則（平成29年3月22日改正）

この内規は、平成29年3月22日から施行し、改正後の別表の規定は、平成29年3月1日から適用する。

附 則（平成29年3月31日改正）

この内規は、平成29年4月1日から施行する。

附 則（平成29年9月25日改正）

この内規は、平成29年10月1日から施行する。

附 則（令和元年10月1日改正）

この内規は、令和元年10月1日から施行する。

東北大学材料科学高等研究所共通利用機器使用料金一覧

(消費税及び地方消費税を含む。)

機器名	仕様・型式	使用料金(円/h)	設置場所	備考
FE-SEM	JEOL JSM-7800F	774	AIMR 本館 2A	
XRD 1号機	RIGAKU SmartLab9MTP	950	AIMR 本館 2A	
EB Lithography	ELIONIX ELS-3700	1,936	AIMR 本館 2A	
3D Printer	Stratasys uPrint SE	47	AIMR 本館 4B	材料費別(モデル材料、サポート材料、モデリングベース、サポート除去剤、中和剤)
Sputtering System	ULVAC QAM-4-S	537	AIMR 本館 2A	材料費別
DSC	Netzsch DSC404F3-ST Pegasus	179	AIMR 本館 4B	材料費別
FT - IR	JASCO FT/IR-6600	749	AIMR 本館 4B	材料費別
XRD 2号機	RIGAKU SmartLab9KAB	950	AIMR 本館 2A	
比表面積・細孔 分布測定装置	Quantachrome Instruments QUADRASORB EVO4	385	AIMR 本館 4B	液体窒素費別
UV-Vis-NIR	JASCO V-770TWK	353	AIMR 本館 4B	
太陽電池・OLEDs 特性評価装置	FLUXiM Paios 3.0	340	AIMR 本館 2A	
AFM	ParkSystems NX10-T2	513	AIMR 本館 2A	
FL	Hitachi High Technologies F-2700	177	AIMR 本館 4B	